PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-137576

(43) Date of publication of application: 14.05.2003

(51)Int.CI.

CO3B 33/027

B28D 5/04

CO3B 33/037

(21)Application number: 2001-338137

(71)Applicant: THK CO LTD

BELDEX CORP

(22)Date of filing:

02.11.2001

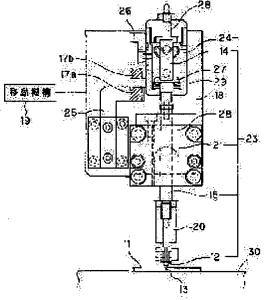
(72)Inventor: ISHIKAWA YUICHI

(54) SCRIBING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a scribing device capable of restricting vibration of a cutter in lateral direction while allowing vibration of the cutter only in longitudinal direction.

SOLUTION: The scribing device is composed of a vibration generation part 14 which generates vibration, and a shaft 15 which transfers the vibration of the vibration generating part 14 to a cutter 12 which is fixed on the shaft 15, and a guiding part 28 which guides axially linear motion of the shaft, magnets 17a, and 17b which adjust a load by magnetic force imparted to a work via the cutter 12, and the guiding part 28 also guide the movement of the shaft 15 (e.g. lifting) caused by the magnets 17a, 17b. The moment load is never generated by providing the guiding parts separately, so the lateral vibration of the cutter 12 is prevented, and the cutter 12 is vibrated smoothly only in longitudinal direction.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

04.08.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-137576 (P2003-137576A)

(43)公開日 平成15年5月14日(2003.5.14)

(51) Int.Cl.'	識別記号	FI	テーマコード(参考)
C 0 3 B 33/027	•	C 0 3 B 33/027	3 C 0 6 9
B 2 8 D 5/04		B 2 8 D 5/04	Z 4G015
C 0 3 B 33/037		C 0 3 B 33/037	

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 8 頁)

(21)出願番号	特顧2001-338137(P2001-338137)	(71)出願人	390029805	
			THK株式会社	
(22)出願日	平成13年11月2日(2001.11.2)		東京都品川区西五反田3丁目11番6号	
		(71)出顧人	390019046	
			株式会社ベルデックス	
			東京都豊島区北大塚1丁目12番15号	
		(72)発明者	石川裕一	
	·		東京都豊島区北大塚1-12-15 株式会社	
			ペルデックス内	
		(74)代理人	100083839	
			弁理士 石川 泰男 (外1名)	

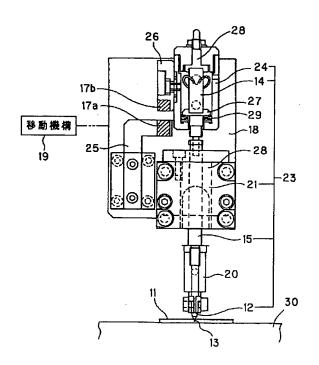
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 スクライブ装置

(57)【要約】

【課題】 カッタが横方向に振動するのを抑え、カッタを縦方向にのみ振動させることができるスクライブ装置を提供する。

【解決手段】 スクライブ装置は、振動を発生する振動発生部14と、カッタ12が取り付けられ、振動発生部14の振動をカッタ12に伝える軸15と、軸15がその中心線方向に直線運動するのを案内する案内部28と、磁力を用いてカッタ12からワーク11に加えられる荷重を調整する磁石17a,17bとを備える。振動発生部14によって軸が振動するのを案内する案内部28と、磁石17a,17bによって軸15が移動(例えば浮上)するのを案内する案内部28とを兼用する。案内部を別々に設けることによってモーメント荷重が生じることができ、カッタ12が横振れするのを防止することができ、カッタ12を縦方向にのみ円滑に振動させることができる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 カッタに振動を付与してワークにスクライブ線を形成するスクライブ装置であって、

振動を発生する振動発生部と、

前記カッタが取り付けられ、前記振動発生部の振動を前 記カッタに伝える軸と、

前記軸がその中心線方向に直線運動するのを案内する案内手段と、

磁力を用いて前記カッタから前記ワークに加えられる荷 重を調整する荷重調整手段とを備え、

前記案内手段は、前記荷重調整手段によって前記軸が移動するのを案内し、且つ前記振動発生部によって前記軸が振動するのを案内することを特徴とするスクライブ装置。

【請求項2】 前記スクライブ装置はさらに、前記カッタを前記ワークに沿って移動させる移動機構を備えるととを特徴とする請求項1に記載のスクライブ装置。

【請求項3】 前記軸の外周には軸線方向に延びる転動 体転走部が形成され、

前記案内手段は、前記軸に嵌まり合い、内周に前記転動 20 体転走部に対応する転動体転走部が形成される外筒と、 前記軸の前記転動体転走部と前記外筒の前記転動体転走 部との間に介在される複数の転動体と、を備えることを 特徴とする請求項1又は2に記載のスクライブ装置。

【請求項4】 前記振動発生部の中心線と前記軸の中心 線が実質的に一直線になることを特徴とする請求項1な いし3いずれかに記載のスクライブ装置。

【請求項5】 前記振動発生部は収納ケースに収納され、該収納ケースには前記軸の振動を前記振動発生部の振動に追従させるために皿状に形成されたばねが設けられることを特徴とする請求項1ないし4いずれかに記載のスクライブ装置。

【請求項6】 カッタに振動を付与してワークにスクライブ線を形成するスクライブ装置であって、

前記ワークに対して移動可能なテーブルと、

振動を発生する振動発生部と、

前記カッタが取り付けられ、前記振動発生部の振動を前 記カッタに伝える軸と、

前記テーブルに取り付けられ、前記軸がその中心線方向に直線運動するのを案内する案内部と、

磁力を用いて前記カッタから前記ワークに加えられる荷 重を調整する磁石と、を備えることを特徴とするスクラ イブ装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ガラス、半導体等の脆性材料からなるワークにスクライブ線を形成するスクライブ装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来からワークの表面にスクライブ線を 50 カッタ1が振動する。カッタ1が横方向に振動すると、

形成するスクライブ装置が知られている。振動させたカッタをワークの表面に押し付けると、ワークの表面に厚さ方向に延びる縦クラックが発生する。ワークの表面に沿ってカッタを移動させると、ワークの表面に連続したスクライブ線(亀裂)が形成される。ワークにスクライブ線を形成した後、スクライブ線に沿ってワークを折り曲げるとワークが切断される。

[0003]図7は、出願人が提案したスクライブ装置を示す。このスクライブ装置はカッタ1を振動させるスクライブ本体2を備える。スクライブ本体2のハウジング3には、振動発生部としての圧電素子が収納されている。ハウジング3の下部からは軸4が突出し、この軸4はハウジング3内に設けた案内部によって上下方向に直線運動可能に案内されている。軸4の下端にはカッタ1が取り付けられる。カッタには、例えば四角錐形状に形成されたダイヤモンド四角錐工具が使用される。圧電素子を振動させると、軸4が振動し、軸4と一緒にカッタ1が振動する。

【0004】ハウジング3はスライドブロック5に取り付けられ、このスライドブロック5は案内部7(例えば直動ガイド)を介してテーブル6に取り付けられる。この案内部7は、スライドブロック5、ハウジング3、軸及びカッタ1で構成されるスクライブ本体2をテーブル6に対して直線運動可能に案内する。テーブル6は移動機構10によってワーク9に対して移動される。

【0005】スクライブ本体2側及びテーブル6側それぞれに取り付けられる一対の磁石8a,8bは、互いに反発し、カッタ1からワークに加えられる静荷重を調整する。磁石8a,8bの反発力によってカッタ1を浮き上がらせると、カッタ1からワーク9に加わる静荷重(振動発生部が振動していないときにカッタからワークに加わる荷重)が調整される。このときスクライブ本体2は、案内部7によって浮き上がるのが案内されている。

【0006】上記スクライブ装置によれば、カッタ1を振動させることができると共に、カッタ1からワーク9に加わる静荷重をワークの種類、厚さ等に応じて最適に調整することができる。

[0007]

40

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来のスクライブ装置では、スクライブ本体2が浮き上がるのを案内する浮上用の案内部7と、軸4が振動するのを案内する振動用の案内部とが別々に設けられ、しかも浮上用の案内部7と振動用の案内部とは左右方向に位置が距離しだけずらされている。このため、軸4が振動するとスクライブ本体2を片持ち支持する浮上用の案内部7にモーメント荷重が発生する。

【0008】モーメント荷重が発生すると、縦方向(図中上下方向)だけでなく、横方向(図中左右方向)にもカッターが振動する。カッターが横方向に振動すると

カッタ1からワーク9に加えられる荷重に横方向の分力が生じてしまい、これによりワーク9の表面に水平クラック等が生じ、ワーク9の品位が悪くなるおそれがある。

【0009】また振動発生部が振動すると、カッタ1のみならずスクライブ本体2も振動するが、案内部7に働くモーメント荷重によって案内部7の追従性が悪くなり、このためスクライブ本体2が振動するときに抵抗が生じる。

【0010】さらに浮上用の案内部7と振動用の案内部 10 を別に設けると、スクライブ本体の構造が複雑化し、スクライブ本体の質量が大きくなる。ワーク9の平坦度が悪い場合や、一旦形成したスクライブ線に交差するようにカッタを移動させる場合は、スクライブ本体2が上下に浮き沈むので、スクライブ本体の全体の質量が大きくなると、スクライブ本体の慣性力が大きくなる。このため、カッタ1からワーク9に加えられる荷重の変動も大きくなる。

【0011】そこで、本発明は、カッタが横方向に振動するのを抑え、カッタを縦方向にのみ振動させることが 20 できるスクライブ装置を提供する。

【0012】また本発明のさらに他の目的は、構造を単純にして振動する部分の質量を軽減することができるスクライブ装置を提供することにある。

[0013]

題を解決する。

【課題を解決するための手段】以下、本発明について説明する。なお、本発明の理解を容易にするために添付図面の参照番号を括弧書きにて付記するが、それにより本発明が図示の形態に限定されるものでない。

【0014】本発明者は上記課題を解決するために、浮上用の案内部と振動用の案内部とを兼用し、スクライブ本体の構造を簡略化した。

【0015】具体的には請求項1の発明は、カッタ(12)に振動を付与してワーク(11)にスクライブ線(13)を形成するスクライブ装置であって、振動を発生する振動発生部(14)と、前記カッタ(12)が取り付けられ、前記振動発生部(14)の振動を前記カッタ(12)に伝える軸(15)と、前記軸(15)がその中心線方向に直線運動するのを案内する案内手段(28)と、磁力を用いて前記カッタ(12)から前記ワー40ク(11)に加えられる荷重を調整する荷重調整手段(17a,17b)とを備え、前記案内手段(28)は、前記荷重調整手段(17a,17b)とを備え、前記案内手段(28)は、前記荷重調整手段(17a,17b)によって前記軸(15)が移動するのを案内し、且つ前記振動発生部(14)によって前記軸(15)が振動するのを案内することを特徴とするスクライブ装置により、上述した課

【0016】との発明によれば、振動発生部によって軸が振動するのを案内する案内手段と、荷重調整手段によって軸が移動(例えば浮上)するのを案内する案内手段 50

とを兼用することができる。このため、従来のスクライブ装置のように案内手段を別々に設けることによってモーメント荷重が生じることがない。したがって、カッタが横振れするのを防止することができ、カッタを縦方向にのみ円滑に振動させることができる。

【0017】また案内手段を兼用することで、構造を簡単にすることができ、振動する部分の質量も軽量化することができる。これにより、荷重の変動を小さくすることができる。

【0018】 ことで案内手段には軸が往復運動するのを 案内することができれば種々のものを用いることがで き、例えばリニアガイド、ボールスプラインガイド、ボ ールブッシュガイド、すべり軸受けガイド等を用いるこ とができる。

【0019】請求項2の発明は、請求項1に記載のスクライブ装置において、前記スクライブ装置はさらに、前記カッタ(12)を前記ワーク(11)に沿って移動させるための移動機構(19)を備えることを特徴とする。

10 【0020】カッタをワークに沿って移動させると、ワークにスクライブ線が形成される。

【0021】請求項3の発明は、請求項1又は2に記載のスクライブ装置において、前記軸(15)の外周には軸線方向に延びる転動体転走部(15a)が形成され、前記案内手段(28)は、前記軸(15)に嵌まり合い、内周に前記転動体転走部(15a)に対応する転動体転走部(16a)が形成される外筒(16)と、前記軸(15)の前記転動体転走部(15a)と前記外筒

(16)の前記転動体転走部(16a)との間に介在される複数の転動体とを備えることを特徴とする。

【0022】この発明によれば、軸の周囲を外筒で案内しているので、軸が振動するときに軸を安定して案内することができる。また軸と外筒との間には転動体が介在されるので、軸が外筒に対して振動するときに生じる抵抗も小さくなる。

【0023】請求項4の発明は、請求項1ないし3いずれかに記載のスクライブ装置において、前記振動発生部(14)の中心線と前記軸(15)の中心線が実質的に一直線になることを特徴とする。

【0024】この発明によれば、振動発生部の中心線方向の振動を軸に効率良く伝えることができる。これに対し、振動発生部の中心線と軸の中心線がずれると軸にモーメント荷重が加わってしまう。

【0025】請求項5の発明は、請求項1ないし4いずれかに記載のスクライブ装置において、前記振動発生部(14)は収納ケース(24)に収納され、該収納ケース(24)には前記軸(15)の振動を前記振動発生部(14)の振動に追従させるために皿状に形成されたばね(29)が設けられることを特徴とする。

【0026】振動発生部は中心線の方向への振動のみな

==

らず、中心線の方向以外への振動を発生させる場合があ る。との発明によれば、皿状に形成されたばねによっ て、振動発生部は中心線の方向への振動のみが引き出さ れ易くなる。

【0027】また本発明は、請求項6に記載のように、 カッタ(12)に振動を付与してワーク(11)にスク ライブ線(13)を形成するスクライブ装置であって、 前記ワーク(11)に対して移動可能なテーブル(1 8)と、振動を発生する振動発生部(14)と、前記カ ッタ(12)が取り付けられ、前記振動発生部(14) の振動を前記カッタ(12)に伝える軸(15)と、前 記テーブル(18)に取り付けられ、前記軸(15)が その中心線方向に直線運動するのを案内する案内部(2 8)と、磁力を用いて前記カッタ(12)から前記ワー ク(11)に加わる荷重を調整する磁石(17a,17 b)と、を備えることを特徴とするスクライブ装置とし ても構成することができる。

【0028】との発明によれば、振動発生部によって軸 が振動するのを案内する案内部と、磁石によって軸が浮 上するのを案内する案内部とを兼用することができる。 とのため、従来のスクライブ装置のように案内部を別々 に設けることによってモーメント荷重が生じることがな い。したがって、カッタが横振れするのを防止すること ができ、カッタを縦方向にのみ振動させることができ

【0029】また案内部を兼用することで、構造を簡単 にすることができ、振動する部分の質量も軽量化するこ とができる。これにより、荷重の変動を小さくすること ができる。

【0030】また案内部を兼用することで、構造を簡単 にすることができ、スクライブ本体のも軽量化すること ができる。これにより、荷重の変動を小さくすることが でき、薄いワークにも良好なスクライブ線を形成するこ とができる。

[0031]

【発明の実施の形態】以下、添付図面に基づいて本発明 を詳細に説明する。図1及び図2は、本発明の第1の実 施形態におけるスクライブ装置を示す。このスクライブ 装置は、ガラス、半導体、セラミクス等の脆性材料から なる薄板状のワーク11の表面に厚さ方向に延びるスク ライブ線を形成する。ワーク11の表面にはカッタ12 が当接している。カッタ12を振動すると、ワーク11 の表面部分に垂直な縦クラックが発生する。 カッタ12 をワーク11に沿って移動させると、ワーク11には縦 クラックが連続した亀裂、すなわちスクライブ線13が 形成される。

【0032】スクライブ装置は、振動を発生する振動発 生部14と、下端部にカッタ12が取り付けられ、振動 発生部14の振動をカッタ12に伝える軸15と、軸1 5がその中心線方向に直線運動するのを案内する案内部 50 8の正面図を示し、図5は案内部28の側面図を示す。

28 (案内手段) と、磁力を用いてカッタ12からワー ク11に加わる荷重(主に静荷重)を調整する一対の磁 石17a, 17b (荷重調整手段) とを備える。案内部 28は移動機構19によって移動されるテーブル18に 取り付けられる。移動機構19は、カッタ12がワーク 11に沿って移動することができるように、テーブル1 8をXY2軸方向、あるいはXYZ3軸方向等に移動さ れる。

【0033】カッタ12には、四角錐形状に形成された ダイヤモンド四角錐工具が使用される。ワーク11が薄 い場合にはダイヤモンド四角錐工具が使用されるが、ワ ーク11が厚い場合あるいはワーク11がガラス等から なる場合には算盤玉状に形成されたホイール工具が使用 されるとともある。

【0034】振動発生部14には、例えば外部電界を加 えると歪を生じる圧電素子(ピエゾアクチュエータ)が 用いられる。圧電素子に印加する電圧を所定の周波数で 変化させると、圧電素子が周期的に伸縮する。外部電界 を加えることによって圧電素子に応力が発生し、この応 20 力がカッタ12に伝わる。カッタ12に応力が伝わる と、ワーク11の表面に四角錐の凹みと共に垂直クラッ クが形成される。

【0035】振動発生部14の振動をカッタ12に伝え る軸15は、断面略円形をなし、軸15の中心線の方向 に直線運動可能に案内部28に支持される。軸15の下 端側には工具保持部20が設けられる。一方軸15の上 端は振動発生部14に連結されている。軸15の外周に は軸線方向に延びる複数列の転動体転走部としてのボー ル転走溝15aが形成される(図3及び図4参照)。な 30 お、軸15の形状は円形でなくでも四角形等の多角形で あってもよい。また軸15は、軸線方向において断面形 状が変化してもよい。さらに軸15は、中実に形成され ても中空に形成されてもよい。

【0036】振動発生部14の中心線と軸15の中心線 とは、振動発生部14の中心線方向の振動を軸15に効 率良く伝えることができるように実質的に一直線になっ ている。仮に振動発生部14の中心線と軸15の中心線 がずれると軸15にモーメント荷重が加わってしまう。 【0037】軸15がその中心線方向に直線運動するの を案内する案内部28は、軸に嵌まり合う外筒21と、 軸15と外筒21との間に介在される複数の転動体とし てのボール22…とから構成される。案内部28はブラ ケットを介してテーブル18に取り付けられている。と の案内部28は、一対の磁石17a, 17bの浮力によ って軸15が移動(例えば浮上)するのを案内する機能 と、振動発生部14によって軸15が振動するのを案内 する機能とを兼用する。

【0038】図3ないし図5は案内部28の一例を示 す。図3は案内部28の斜視図を示し、図4は案内部2 20

スプライン軸のように形成された軸 15 には軸線方向に 延びる複数列のボール転走溝15aが形成される。軸1 5に嵌め込まれる外筒21の内周には、軸15に形成さ れたボール転走溝15aに対応し、軸線方向に延びる複 数列の転動体転走部としてのボール転走溝21aが形成 される。軸15のボール転走溝15aと外筒21のボー ル転走溝21aとの間には、複数のボール22…が転が・ り運動可能に介在される。外筒21の内部には、ボール 22…を循環させる無限循環経路が形成されると共に複 数のボール22…を保持する保持器34が組み込まれ る。外筒21に対する軸15の相対的な直線運動によっ てボール22…が外筒21と軸15との間を転がり運動 する。ボール22…は転がり運動しながら、無限循環路 を循環する。なお軸15の振幅が小さく設定されること を考慮すると、ボールを循環させる無限循環経路を設け ない有限循環路も採用しうる。また案内部28には、軸 15が往復運動するのを案内することができれば種々の ものを用いることができ、上述のボールスプラインガイ ド以外に、例えばリニアガイド、ボールブッシュガイ - ド、すべり軸受けガイド等も用いることができる。

【0039】図1に示すように、磁力を用いてカッタ1 2に浮力を与える磁石17a, 17bは、軸15が振動 する方向に離間された一対の永久磁石からなる。磁石1 7a. 17bのうち一方17aはテーブル18側に取り 付けられ、他方17bは振動するスクライブ本体23側 (この実施形態では振動発生部14が収納される収納ケ ース24)に取り付けられる。テーブル18にはブラケ ット25が固定されており、このブラケット25に磁石 17aが取り付けられる。収納ケース24にもブラケッ ト26が固定されており、このブラケット26に磁石1 7 bが取り付けられる。ここで磁石17 bは収納ケース に取り付けられているが、振動するスクライブ本体23 側のいずれの部分(例えば軸15)に取り付けられても よい。磁石17a、17bは互いに同極(例えばN極同 士)が対面しており、永久磁石17a, 17b間に働く 反発力によってカッタ12からワーク11に加わる静荷 重が減じられる。

【0040】なお、カッタ12からワーク11に加わる 静荷重を変化させることができるように、磁石17aは 図示しないマイクロメータ等の位置調整機構を用いてそ 40 の高さが調整されてもよい。また永久磁石の代わりに、 磁力を調整可能な電磁石を用いてもよい。さらに磁石1 7a, 17bは、その中心が軸の中心線上に位置するリ ング状に形成されてもよい。

【0041】振動発生部14は収納ケース24に収納される。振動発生部14の下端は軸15の上端に設けたホルダ27に当接していて、振動発生部14の上端は収納ケース24の上部に設けた調整ねじ28に当接している。収納ケース24の下部には、軸15の振動を振動発生部14の振動に追従させるためばね29が設けられ

る。このばね29は、周方向の断面形状が一定となる皿 状に形成される。ばね29はその弾性復元力でホルダ2 7を上方に付勢し、ホルダ27と収納ケース24に取り 付けられた調整ねじ28との間で振動発生部14に与圧 (振動発生部14を軸方向に圧縮する力)を与えてい る。振動発生部14が振動する際にカッタ12がワーク 11から跳ね上がるのを防止するために、収納ケース2 4に錘が取り付けられてもよいし、あるいは収納ケース 24を下方側に付勢するばね、磁石等を設けても良い。 【0042】このスクライブ装置の系は、振動発生部1 4を挟んで質量M1 (軸15及びカッタ12の質量)の 錘と、質量M2(収納ケース24及び浮き上がり防止用 の錘の質量等) の錘が存在するモデルに近い。このた め、振動発生部14に生じる応力を効率良くカッタ12 に伝達するためには、振動発生部14の両側に設けられ る質量M1と質量M2の錘のバランスを最適に設定する ことが重要である。一般的には質量M2を質量M1より も大きくすれば、振動発生部14に生じる応力を効率良 くカッタ12に伝達することができる。

【0043】上記スクライブ装置の使用方法を説明する。まず、水平のベース30にワーク11を位置決めして水平にセットする。移動機構19によりテーブル18をワーク11に対して水平移動させると、カッタ12がワーク11の緑に当たってからワーク11の上面に乗り上げる。カッタ12がワーク11に載り上げると、カッタ12からワーク11に静荷重が付与される。ここで磁石17aの高さを調整すると、磁力による反発力の分だけ静荷重が減じられ、静荷重が調整される。静荷重を大きくしすぎると、ワーク11の表面に横クラックが発生してしまうことがある。逆に、静荷重をあまりに小さくしすぎると、スクライブ本体23を振動させたとき、カッタ12がワーク11から浮き上がり、ワーク11の表面にダメージを与える。静荷重の大きさはワーク11の材質や厚さに応じて設定される。

【0044】所定の静荷重が得られたら、振動発生部14に高周波電界をかけて振動発生部14を周期的に振動させる。振動発生部14の振動は軸を介してカッタ12に伝わる。カッタ12が振動するとワーク11の上面には凹み、並びにこの凹みに連なって垂直クラックが形成される。

【0045】本発明では、振動発生部14によって軸が振動するのを案内する案内部28と、磁石17a、17bによって軸15が浮上するのを案内する案内部28とを兼用している。このため、従来のスクライブ装置のように案内部を別々に設けることによってモーメント荷重が生じることがない。したがって、カッタ12が横振れするのを防止することができ、カッタ12を縦方向にのみ振動させることができる。

【0046】カッタ12を振動させながら移動機構19 50 によってテーブルを水平方向に移動すると、ワーク11

の表面部分に縦クラックからなるスクライブ線13が形 成される。スクライブ線13が形成されたワーク11 - は、ベース30から取り外され、図示しない破断装置に よりスクライブ線に沿って破断される。

【0047】図6は、本発明の第2の実施形態における スクライブ装置を示す。との実施形態のスクライブ装置 も、振動を発生する振動発生部14と、下端部にカッタ 12が取り付けられ、振動発生部14の振動をカッタ1 2に伝える軸15と、軸15がその中心線方向に直線運 12からワーク11に加わる荷重を調整する一対の磁石 (図示せず)とを備える。案内部28は移動機構によっ て移動されるテーブル (図示せず) に取り付けられてい

【0048】との実施形態では、振動発生部として磁界 を加えると磁性体に歪を生じる磁性材料が用いられ、具 体的には特により変位量の大きい超磁歪素子31が用い られている。

【0049】超磁歪素子31の周囲には磁界を与えるた めのコイル32が巻かれている。この超磁歪素子31も 20 収納ケース24に収納される。超磁歪素子31の下端は 軸15の上端に設けたホルダ27に当接していて、超磁 歪素子31の上端は収納ケース24の上部に当接してい る。収納ケース24の下部には、軸15の振動を超磁歪 素子31の振動に追従させるためばね29が設けられ る。このばね29は、周方向の断面形状が一定となる皿 状に形成される。ばね29は、その弾性復元力でホルダ 27を上方に付勢し、ホルダ27と収納ケース24の上 部との間で超磁歪素子31に与圧(超磁歪素子31を軸 方向に圧縮する力)を与えている。

【0050】超磁歪素子31に印加する磁界を所定の周 波数で変化させると、超磁歪素子31が周期的に伸縮す る。すなわち外部磁界を加えることによって、超磁歪素 子31に応力が発生し、この応力がカッタ12に伝わ る。一般に超磁歪素子31はその発生応力が圧電素子よ りも大きい。このため、超磁歪素子31は、カッタ12 に大きな応力が伝わるのが望ましいガラス等を切断する ときに用いられる。

[0051]

* 【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 振動発生部によって軸が振動するのを案内する案内手段 と、静荷重調整手段によって軸が移動(例えば浮上)す るのを案内する案内手段とを兼用しているので、従来の スクライブ装置のように案内手段を別々に設けることに よりモーメント荷重が生じることがない。したがって、 カッタが横振れするのを防止することができ、カッタを 縦方向にのみ円滑に振動させることができる。また案内 手段を兼用することで、構造を簡単にすることができ、 動するのを案内する案内部28と、磁力を用いてカッタ 10 振動する部分の質量も軽量化することができる。これに より、荷重の変動を小さくすることができる。

【図面の簡単な説明】

(6)

【図1】本発明の第1の実施形態におけるスクライブ装 置を示す正面図。

【図2】上記図1のスクライブ装置の側面図。

【図3】上記図1のスクライブ装置の案内部を示す斜視

【図4】上記案内部の正面図(一部断面を含む)。

【図5】上記案内部の側面図(一部断面を含む)。

【図6】本発明の第2の実施形態におけるスクライブ装 置を示す垂直方向断面図。

【図7】従来のスクライブ装置を示す図。

【符号の説明】

11…ワーク

12…カッタ

13…スクライブ線

14…振動発生部

15…軸

15a…ボール転走部(転動体転走部)

30 16 a…ボール転走部(転動体転走部)

16…外筒

17a, 17b…磁石(荷重調整手段)

18…テーブル

19…移動機構

22…ボール(転動体)

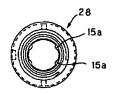
24…収納ケース

28 …案内部 (案内手段)

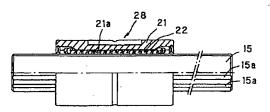
29…ばね

*

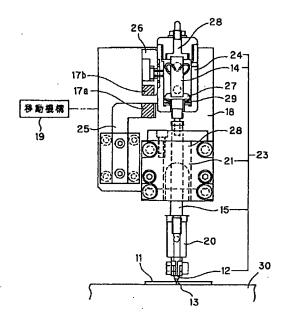
【図4】



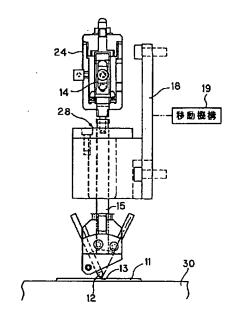
【図5】



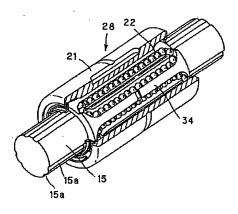
【図1】



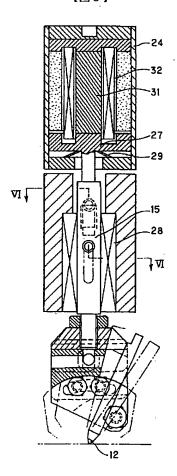
[図2]

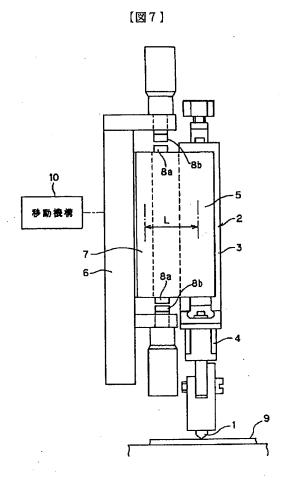


[図3]



【図6】





フロントページの続き

F ターム(参考) 3C069 AA03 BA03 BB01 BB04 BC02 CA05 CA11 EA01 EA02 4G015 FA03 FB01 FB03 FC08 FC14